○国立大学法人長岡技術科学大学受託試験等取扱規程

平成16年4月1日
規程第36号

改正 平成17年9月30日規程第12号 平成20年2月27日規程第18号
平成27年3月26日規程第11号 平成29年3月31日規程第13号
令和2年12月28日規程第7号 令和4年1月12日規程第10号
令和5年1月24日規程第14号 令和6年6月19日規程第8号
令和6年11月29日規程第14号 令和7年3月25日規程第23号

(趣旨)

第1条 国立大学法人長岡技術科学大学（以下「本学」という。）において、学外からの依頼により行う試験、分析等（以下「受託試験等」という。）の取扱いについては、この規程の定めるところによる。

(受託試験等)

第2条 受託試験等は、次の各号に掲げるとおりとする。

- 一 別表第1に定めるもの
 - 二 別表第2に定める機器を使用した分析、測定等
 - 三 前2号に掲げるもののほか、学長が受託することが適当であると認めたもの
- (受託料金)

第3条 受託試験等に係る料金（以下「受託料金」という。）は、次の各号に掲げるとおりとする。

- 一 別表第1に掲げるものは、同表受託料金による。
- 二 別表第2に掲げるものは、同表機器使用料金による。
- 三 前条第3号に掲げるものは、学長が別に定めるものとする。

(受託試験等の依頼)

第4条 受託試験等を依頼しようとする者（以下「依頼者」という。）は、受託試験等依頼書（別紙様式第1）に、所定の事項を記入の上、必要な資料を添えて、学長に提出しなければならない。

(承認要件及び承認)

第5条 学長は、前条の受託試験等の依頼を受けたときは、次の各号に掲げる要件に合致する場合に限り、受託の承認をするものとする。

- 一 教育研究上有意義であること。
- 二 本学の教育、研究その他運営上支障を生じるおそれがないこと。
- 三 受託するに不適當な条件等が付されていないこと。

2 前項の承認にあたり、当該受託試験等において、学内共同教育研究施設が管理する機器を使用する場合にあっては、当該施設の長と協議するものとする。

(承認等の通知)

第6条 学長は、前条により受託を承認したときは、依頼者に受託試験等受託承認通知書（別紙様式第2）をもって通知するものとする。

（受託試験等の結果通知）

第7条 学長は、受託試験等が完了したときは、その結果を依頼者に受託試験等結果通知書（別紙様式第3）をもって通知するものとする。

（受託料金の納付）

第8条 依頼者は、前条による結果の通知を受けた時は、第3条で定める受託料金を納付しなければならない。

2 納付された受託料金は、原則として返還しない。

（試験試料の措置）

第9条 依頼者が受託試験等のため提出した試験試料（以下「試料」という。）は原則として返還しないものとする。ただし、試験の開始前に返還の申出があり学長の承認を得たものはこの限りでない。

（諸費用の負担）

第10条 受託試験等に係る試料の搬入搬出に必要な費用は、すべて依頼者の負担とする。

（試料の損害責任）

第11条 天災地変その他不可抗力による試料の損害については、本学はその責めを負わないものとする。

（雑則）

第12条 この規程に定めるもののほか、受託試験等の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

附 則

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附 則（平成17年9月30日規程第12号）

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

附 則（平成20年2月27日規程第18号）

この規程は、平成20年2月27日から施行し、平成20年2月1日から適用する。

附 則（平成27年3月26日規程第11号）

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則（平成29年3月31日規程第13号）

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附 則（令和2年12月28日規程第7号）

この規程は、令和2年12月28日から施行する。

附 則（令和4年1月12日規程第10号）

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

附 則（令和5年1月24日規程第14号）
この規程は、令和5年1月24日から施行する。

附 則（令和6年6月19日規程第8号）
この規程は、令和6年6月19日から施行する。

附 則（令和6年11月29日規程第14号）
この規程は、令和6年11月29日から施行する。

附 則（令和7年3月25日規程第23号）
この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1（第2条、第3条関係）

機械試験

受託試験等	試験等単位	受託料金
		円
細骨材比重試験	1 試料	15,500
細骨材吸水量試験	1 試料	15,500
金属材料引張試験	1 試料（1本）	4,900
コンクリート圧縮試験	1 試料（1本）	2,200
骨材単位容積質量試験	1 試料	12,500
紙・金属・樹脂等の複合板材に関する曲げ成形試験	1 試験	54,200
紙・金属・樹脂等の複合板材に関する面外圧試験	1 試験	85,400
紙・金属・樹脂等の複合板材に関する面外引剥試験	1 試験	48,100
紙・金属・樹脂等の複合板材に関する断裁・押抜試験	1 試験	55,500
紙・金属・樹脂等の複合板材に関する面内引張試験	1 試験	57,700

備考

（注1） 別途、電気料金、消耗品等が必要な場合は追加料金が発生する。

別表第2（第2条、第3条関係）

分析試験

（時間単価）

装置名	機器使用料金 （依頼測定）	機器使用料金 （共同研究測定）	備考
	円（税抜）	円（税抜）	

電界放出形電子線マイクロアナライザ FE-EPMAJEOL JXA-iHP200F	6,000	10,000	SXESは別途相談
	10,000	14,000	
グロー放電発光分析装置 GD-OESHoriba GD-Profiler 2	5,000	9,000	
	8,000	12,000	
全自動光電子分光装置 XPS/UPSThermo F isher Scientific Nexsa	6,000	10,000	XPSのみ、その他のオプション 利用は別途相談
	10,000	14,000	
X線光電子分光装置 XPSJEOL JPS-9010TR	3,400	7,400	
	4,800	8,800	
オージェ電子分光装置 AESJEOL JAMP-95 00F	5,000	9,000	
	8,000	12,000	
フーリエ変換赤外分光装置 FT-IRShimad zu IRTracer-100	3,800	7,800	
	5,600	9,600	
フーリエ変換赤外分光装置 FT-IRJASCO FT/IR-4100	2,800	6,800	
	3,600	7,600	
レーザーラマン分光装置 LRSJASCO NRS- 7200	3,400	7,400	
	4,800	8,800	
冷却加熱レーザーラマン分光光度計 LR STokyo Instruments NanofinderFlex	3,400	7,400	低温測定時液体窒素代 (実費)が追加
	4,800	8,800	
紫外可視近赤外分光光度計 UV-Visible/ NIRJASSO V-770	2,800	6,800	
	3,600	7,600	
分光蛍光光度計 FLJASCO FP-8550	2,800	6,800	
	3,600	7,600	
電子スピン共鳴分光装置 ESRJEOL JES-R E 2X	2,400	6,400	
	2,800	6,800	
In-plane型X線回折装置 In-plane XRDRi gaku SmartLab 9kW	3,600	7,600	
	5,200	9,200	
低温X線回折装置 Low temperature XRDRi gaku SmartLab 9kW	3,600	7,600	低温測定時液体窒素代 (実費)が追加
	5,200	9,200	
粉末X線回折装置 Powder XRDRigaku Sma rtLab 3kW	3,400	7,400	
	4,800	8,800	
蛍光X線分析装置 XRF Rigaku ZSX Primus III+	3,400	7,400	
	4,800	8,800	
蛍光X線分析装置 XRF Rigaku ZSX Primus II	3,400	7,400	
	4,800	8,800	
ICP発光分光分析装置 ICP-OESShimadzu ICPE-9820	5,000	9,000	
	8,000	12,000	
原子吸光分光光度計 AASShimadzu AA-70 00	3,200	7,200	
	4,400	8,400	

熱分解ガスクロマトグラフ飛行時間質量分析計 GC-TOF-MSJEOL JMS-T200GCx-plus	8,000	12,000	熱分解ユニット利用時試料カップ代（実費）が追加
	14,000	18,000	
電界放出形透過電子顕微鏡 FE-TEMJEOL JEM-2100F	6,000	10,000	
	10,000	14,000	
透過電子顕微鏡 TEMHitachi HT7700	6,000	10,000	
	10,000	14,000	
冷陰極電界放出形走査電子顕微鏡 Cold FE-SEMHitachi SU8230	6,000	10,000	
	10,000	14,000	
冷陰極電界放出形走査電子顕微鏡 Cold FE-SEMHitachi SU8000	4,000	8,000	
	6,000	10,000	
ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡 Schottky FE-SEM JEOL JSM-IT800 (SHL)	6,000	10,000	SXES利用は別途相談
	10,000	14,000	
走査電子顕微鏡 SEMHitachi FlexSEM1000 II	3,600	7,600	
	5,200	9,200	
cryo走査電子顕微鏡 cryoSEMJEOL JSM-IT200	3,600	7,600	cryo stage利用は別途相談
	5,200	9,200	
卓上走査電子顕微鏡 DesktopSEMHitachi TM3030Plus	3,000	7,000	
	4,000	8,000	
卓上走査電子顕微鏡 BenchtopSEMJEOL JCM-6000Plus	3,200	7,200	
	4,400	8,400	
X線マイクロCTスキャン X-ray CTBruker SkyScan1172	6,000	10,000	
	10,000	14,000	
ナノ3D光干渉計測システム CSIHitachi VS1800	3,000	7,000	
	4,000	8,000	
走査プローブ顕微鏡 SPMHitachi E-sweep	2,800	6,800	
	3,600	7,600	
複合ビーム加工観察装置 FIB/FE-SEMJEOL JIB-4700F	7,000	11,000	
	12,000	16,000	
集束イオンビーム加工装置 FIBHitachi FB2200	7,000	11,000	
	12,000	16,000	
イオンミリング Ion Milling MachineHitachi IM4000Plus	3,000	7,000	
	4,000	8,000	
SEM用イオンミリング装置 SEM MillFischione Instruments Model1061	3,000	7,000	
	4,000	8,000	
ウルトラマイクロトーム UltramicrotomeLeica EM UC7	3,600	7,600	
	5,200	9,200	
	2,800	6,800	

レーザー回折式粒度分布計 LDMalvern Panalytical Mastersizer3000	3,600	7,600	
粒度分布/ゼータ電位計 DLSMalvern Panalytical Zetasizer Pro	2,800	6,800	
	3,600	7,600	
比表面積・細孔分布測定装置 BET/BJH Shimadzu TriStar3000	2,600	6,600	
	3,200	7,200	
熱重量/示差熱測定装置 TG/DTA Rigaku TG-DTA8122	2,800	6,800	
	3,600	7,600	
示差走査熱量計 DSC Rigaku DSCvesta 2	2,800	6,800	
	3,600	7,600	
イオン化エネルギー測定装置 IEBunko Keiki BIP-KV100J	3,600	7,600	
	5,200	9,200	

備考

(注1) 上段は高等教育機関その他学長が認める機関等、下段は上段に含まれない機関等の料金とする。

(注2) 別途、電気料金、前処理、加工、消耗品等が必要な場合は追加料金が発生する。

(注3) 依頼測定とは技術職員による分析、測定等であり、専門的知識の提供を含まない。

(注4) 共同研究測定とは教員、技術職員による分析、測定等であり、専門的知識の提供を含む。

別紙様式第1 (第4条関係)

受託試験等依頼書

[別紙参照]

別紙様式第2 (第6条関係)

受託試験等受託承認通知書

[別紙参照]

別紙様式第3 (第7条関係)

受託試験等結果報告書

[別紙参照]